

計測器の校正は、「正確」「信頼」「安心」のJQAにお任せください。

ISO/IEC 17025に基づく校正機関として認定を受け、
信頼性の高い校正サービスを提供します。

主な校正対象分野

- 長さ・電気・放射線・温度・湿度・質量・硬さ・力・トルク・圧力・密度・
体積・流速・流量・音響・加速度・濃度・時間等の計測器の校正

- 各種出張校正

小間番号 東2ホール V-21

一般財団法人 日本品質保証機構

お問い合わせ 計量計測センター 事業推進課 TEL:03-3416-5554
〒157-8573 東京都世田谷区砧1-21-25**JQA**<http://www.jqa.jp>

SP企画第14回会員研究会・真空トピックス

会員 100名

日時 10/15(水) 13:00~16:35 会場 会議棟 606会議室

主催 日本真空学会/日本真空工業会

懇親会 日本真空学会・日本真空工業会会員 3,000円

※スパッタリングおよびラズマロセス技術部会会員 無料

一般 5,000円 学生 1,000円 (料金代・消費税込み)

講演プログラム ※ご質問が追加となった場合、プログラムの時間に変更があります。ご了承下さい。

開会挨拶 13:00~13:10 ISSP2015 実行委員長/セントラル硝子 加藤 和広 氏

成膜技術を用いたデバイス開発とセンシングへの応用 13:10~13:55 東京医科歯科大学 三林 浩二 氏

半導体技術を活用したメカニカルバイス・システム(仮題) 13:55~14:40 ローム 丹羽 大介 氏

欧州のフレキシブルエレクトロニクス関連技術開発動向と日本 15:00~15:45 鈴木 巧一 氏

サーフェットランナショナル

生活支援ロボットの実用化の問題点 15:45~16:30 生活支援ロボット安全監査センターの紹介を通じて~ 産業技術総合研究所

閉会の挨拶 16:30~16:35 日本真空学会 スパッタリングおよびラズマロセス技術部会 部会長/東海大学 大場 光太郎 氏

沖村 邦雄 氏

真空入門講座 会員 90名

日時 10/15(水)~17(金) 各10:00~12:00 会場 会議棟6階 609会議室 (主催)日本真空工業会

懇親会 一般 3,000円 学生 1,000円 (料金代・消費税込み)

講演会 1. 真空の歴史 2. 真空の基礎 3. 真空計測 4. 真空ポンプ 5. 真空用材料 6. 真空部品 7. 真空装置の構成

担当講師 10/15(水) 山口大学大学院 理工学研究科 物質工学専攻 教授 栗巣 普揮 氏

10/16(木) 日本電子(株) 品質保証室 製品順法グループ 次長 河合 英治 氏

10/17(金) 神港精機(株) 滋賀守山工場 工場長付 浅見 博 氏

第15回 真空シンポジウム 会員 100名

日時 10/16(木) 14:30~16:50 会場 東1ホール ワークショップ会場

主催 日本真空学会 産業連携委員会/日本真空工業会

懇親会 一般 2,000円 (料金代・消費税込み)

講演会 ■基調講演 「MEMSの現在の市場と次世代のアプリケーション」 東山 默 氏

開会挨拶 14:30~14:35 日本真空学会 産業連携委員会 委員長 土岐 和之 氏

生活に欠かせない真空利用技術 14:35~15:15 真空テクノサポート・元日本真空工業会 専務理事 木ノ切 治恭 氏

真空管から真空ナノエレクトロニクスへ 15:15~15:55 京都大学大学院 工学研究科 電子工学専攻 准教授 後藤 康仁 氏

ミニマルファブ構造~装置と部品の小型化の挑戦~ 16:05~16:45 産業技術総合研究所 ミニマルシステムグループ長 原 史朗 氏

閉会挨拶 16:45~16:50 日本真空学会 産業連携委員会 副委員長 富江 崇 氏

■一般講演 「RF-MEMSデバイスとその応用の現状と今後」(仮) 富士通研究所 ものづくり技術研究所 ハードウェアエンジニアリング研究部 主管研究員 中澤 文彦 氏

「MEMS光スキャナの特徴と産業への展開」 日本信越セミナー・ビジネスセンター MEMS事業推進部 川崎 栄嗣 氏

「バイオセンサー技術における健康センサーの進展」 タンタ 営業戦略本部 国際製品部 次長 伊藤 成史 氏

「MEMS製造技術の現状と今後の展望」 アルババ 技術開発部 素要技術開発部 新分野技術開発室 上村 隆一郎 氏

(10月7日時点)

真空フォーラム2014 会員 200名

日時 10/17(金) 13:00~17:00 会場 会議棟6階(605~606会議室)

主催 日本真空工業会 展示会委員会 フォーラム・セミナー小委員会

懇親会 一般 3,000円 (料金代・消費税込み)

講演会 ■基調講演 「MEMSの現在の市場と次世代のアプリケーション」 下山 默 氏

■一般講演 「RF-MEMSデバイスとその応用の現状と今後」(仮) 富士通研究所 ものづくり技術研究所 ハードウェアエンジニアリング研究部 主管研究員 中澤 文彦 氏

「MEMS光スキャナの特徴と産業への展開」 日本信越セミナー・ビジネスセンター MEMS事業推進部 川崎 栄嗣 氏

「バイオセンサー技術における健康センサーの進展」 タンタ 営業戦略本部 国際製品部 次長 伊藤 成史 氏

「MEMS製造技術の現状と今後の展望」 アルババ 技術開発部 素要技術開発部 新分野技術開発室 上村 隆一郎 氏

(10月7日時点)



15日~17日 東京ビッグサイトで開催

「VACUUM2014」は、半導体・薄型ディスプレイ(FPD)・太陽電池・電子分野だけでなく、食品・医療・分析機器や、昨今注目を集める環境関連分野など、ほどんど全ての産業分野に関する基盤技術。こうした規模の専門展示会として知られ、最新の技術や機器が披露される。開場時間は10時から17時まで。入場料は1,000円(事前登録者または招待券持参者は無料)。

日本真空学会と日本真空学会が主催する「VACUUM2014」が、15日(水)から17日(金)までの3日間、東京ビッグサイトで第36回「VACUUM2014」が開かれます。テックトピックスとして、最新の技術や機器が披露される。開場時間は10時から17時まで。入場料は1,000円(事前登録者または招待券持参者は無料)。

最新の技術や機器・装置を披露

日本真空工業会会長 酒井 純朗

日本真空工業会会長 酒井 純朗

酒井 純朗